



VES-10 形

# マルチ成膜装置

カーボン蒸着・金属スパッタ・親水処理の3機能

- 2チャンバー、3種処理機能を搭載した電子顕微鏡向け複合前処理装置です。
- 弊社でも最も需要の多いVC-100S・MSP-1S・PIB-10がこれ1台でOK。
- 自動プログラムにより、フルオート処理やインターロック機能を充実しました。
- 床置き500RPを採用。振動・共振への配慮とメンテナンスし易さを考慮しました。
- チャンバーは2系統共に真空保持が可能です。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

## 特 徴 ・ 仕 様

### 特 徴

- ★ この装置は、2つの試料処理チャンバーを持つ多目的簡易操作型カーボン蒸着、マグネトロンスパッタ成膜、親水処理機能を有する装置です。
- ★ 床置きロータリーポンプ(1mホース付)による排気で、オートリーク機能搭載。
- ★ 1台で当社製 VC-100S・MSP-1S・PIB-10 3機種 of 機能を有します。
- ★ 小形省スペース・多機能・簡易操作を製品コンセプトに、初心者でも安心です。
- ★ カーボン蒸着はシャープペンシルの替え芯を使用。固定電圧を3段切替。
- ★ マグネトロンスパッタ成膜、親水処理はフルオート処理。操作はタイマー調整のみ

### 仕 様

#### 1)カーボン蒸着

- \* シャープペンシル芯専用カーボン蒸着装置
- \* カーボン整形不要、誰でも簡単操作
- \* 成型材の焼き出しに BAKE(2V)、ガス出しに OUT-GAS(5V)、蒸着に EVAPO(15V)の3段切替。
- \* 電圧固定式なので、複数人の使用でも再現性の高い蒸着が可能です。

#### 2)イオンコーター

- \* 直流電圧並行平板型マグネトロン電極方式で、低電圧コーティングを実現。
- \* ターゲット: Au, Pt, Au-Pd, Pt-Pd, Pd, Ag 使用可能 50mmΦ
- \* 放電電源: DC500V 固定、0~50mA(可変抵抗器による微調整)
- \* ターゲット/試料間隔: 35mm 固定
- \* コーティング面内膜厚ムラ: 5%以内(φ50mm)、40%以内(φ74mm)
- \* 試料台サイズ: 50mmΦ アノード電極分離フローティング方式
- \* タイマー: オムロン社製電子タイマー
- \* 雰囲気ガス導入: 圧力調整・導入管は装備しておりません。

#### 3)親水処理

- \* イオンコーター側のオートプロセススイッチを押すだけです。
- \* 放電電源: HYD(S)AC450V 10~20mA / HYD(H)AC550V 20~30mA
- \* TEM 用支持膜の親水化、ダイヤモンドナイフのクリーニングなどに使用。
- \* 電極サイズ: 50mmΦ、アルミ製

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。